**共同利用・共同研究拠点 「先進超高圧科学研究拠点（PRIUS）」**

**共同利用・共同研究申請書（2020年度）**

　　申請日　　　　年　　　月　　　日

**研究代表者**（※性別・年齢区分は文科省への報告の際に必要な事項であり，当該目的にのみ使用いたします．）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ふりがな |  | 性別 |  | 35歳以下ですか？　はい[ ]  いいえ[ ] 39歳以下ですか？　はい[ ]  いいえ[ ]  |
| 氏名 |  |
| 所属機関・部局 |  |
| 職名 |  |
| 所属機関住所 | 〒 |
| 電話 |  |
| E-mail |  |

**応募種目**（いずれかを囲むか，下線を引いて下さい） 　　　　　　　　　　　　　**申請の新規・継続の別**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. 設備利用型共同研究　　　B. 一般共同研究　　　C. 研究集会 |  | 新規　　・　　継続 |

**研究課題名または研究集会名**

|  |  |
| --- | --- |
| 和文： |  |
| 英文： |  |

**申請課題に最も近いと思われる研究分野**（いずれかを囲むか，下線を引いて下さい）

|  |
| --- |
| 地球科学　・　化学　・　物理学　・　数学　・　材料科学　・　工学　・　その他（　　　　　　　　　　　） |

**研究分担者**（注1，2）　　　 　　　　　　　　（※性別・年齢区分は文科省への報告の際に必要な事項であり，当該目的にのみ使用いたします．）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏　名 | 年齢区分 | 性別 | 所属機関・部局 | 職名(注3) | E-mail |
| **受入担当教員** |  |  | 愛媛大学・地球深部ダイナミクス研究センター |  |  |
|  | ＜35歳 [ ] ＜39歳 [ ]  |  |  |  |  |
|  | ＜35歳 [ ] ＜39歳 [ ]  |  |  |  |  |
|  | ＜35歳 [ ] ＜39歳 [ ]  |  |  |  |  |
|  | ＜35歳 [ ] ＜39歳 [ ]  |  |  |  |  |
|  | ＜35歳 [ ] ＜39歳 [ ]  |  |  |  |  |

（注1）研究分担者には受入担当として，GRC専任教員を最低1名は必ず加えて下さい。

（注2）申請代表者が大学院生の場合は，指導教員を分担者に含めて下さい。

（注3）大学院生は課題遂行年度の4月時点での学年（例．M1，D2など）を記入してください。

**申請にあたり公募要項に記載の事項・注意点について了解しました．** はい [ ] （←チェックを入れてください）

（以下は合計2ページ以内で記述して下さい）

**研究計画：研究または集会の概要・目的・方法・計画ならびに期待される成果など**

|  |
| --- |
| ＊「設備利用型共同研究」の場合，下段に利用する機器・設備名と使用回数・使用時期を必ず明記して下さい（末尾の装置・機器リスト参照）．＊ナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ）利用の場合，希望する加工形状・数など仕様を記載して下さい．別紙添付でも構いません．＊高額消耗品（焼結・単結晶ダイヤモンドアンビル，特殊な超硬アンビル（募集要項参照），貴金属チューブなど）は，原則各自でご用意ください．＊「研究集会」の場合，開催場所・開催時期・予定参加者も記載して下さい．(上記注意事項は作成時には削除して下さい) |
| 使用装置名 | 年間使用予定（実験回数もしくは使用日数） | 備考 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 実験に必要なヒメダイヤの個数および形状・仕様※ヒメダイヤを使用する場合 |  |

**本申請内容に関係する業績**（発表論文，学会発表，受賞，特許など，申請代表者・分担者を問いません）

|  |
| --- |
|  |

**本申請内容に関係する他の研究経費**（他研究経費との相乗効果を把握するもので，申請の評価には関係しません）

|  |
| --- |
|  |

**PRIUS装置・機器リスト**

1. **超高圧装置群（超高圧実験装置と関連装置）**
2. マルチアンビル超高圧発生装置　Orange-1000
3. マルチアンビル超高圧発生装置　Orange-3000
4. D-DIA型超高圧変形装置　Madonna I
5. DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高圧装置　Madonna II
6. ダイヤモンドアンビルセル　DAC
7. DAC用ファイバーレーザー加熱システム　Fiber laser
8. DAC用CO2レーザー加熱システム　CO2 laser
9. マルチアンビル装置用高圧下弾性波速度測定装置　Ultrasonic（TDS5104）
10. **微小試料分析装置（電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等）**
11. 電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）　FE-SEM-EDS（JSM-7000F・X-Max）
12. 電界放出型走査電子顕微鏡（EBSD分析）　FE-SEM-EBSD　(JSM-7000F)
13. 走査型電子顕微鏡（EDS付き）　SEM-EDS (JSM-6510LV・X-Max)
14. 電界放出型透過電子顕微鏡（EDS付き）　FE-TEM（JEM-2100F）
15. 透過電子顕微鏡　TEM（JEM-2010）
16. 集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置　Dual Beam FIB（Scios）
17. 集束イオンビーム加工装置　FIB（JEM-9310FIB）
18. 微小領域X線回折装置　Micro-focus XRD（RAPIDII-V/DW）
19. 粉末Ｘ線回折装置　Powder XRD（Ultima IV/DD）
20. 顕微ラマン分光装置（日本分光）　Micro-Raman Spectroscopy（NRS-5100gr）
21. 顕微ラマン分光装置（Photon Design）　Micro-Raman Spectroscopy（RSM 800）
22. 顕微近赤外レーザーラマン分光装置 Micro-Raman (NIR) Spectroscopy（NRS-4500）
23. 顕微赤外分光装置　FT-IR（Spectrum One）
24. 紫外可視近赤外分光システム　UV-Vis-NIR（V-670）
25. レーザー顕微鏡　Laser microscope（OPTELICS HYBRID L3）
26. イオン研磨加工装置（イオンスライサ）Ion Slicer（EM-09100IS）
27. イオン研磨加工装置（クロスセクションポリッシャ）Cross Section Polisher（IB-19510CP）
28. イオン研磨装置 PIPS（Model 691）
29. **加工装置・その他の特徴ある装置**
30. 超音波加工機（UM-150CS）
31. 自動パーツ加工機①　Automatic processing machine（MDX-540）
32. 高温雰囲気炉①② 大型炉（ATCM50-100/1700）, 小型炉（TS-4B06）
33. マイクロビッカース高度計（HMV-G21DT）
34. **数値計算用コード**
35. 鉱物物性シミュレーションコード
36. 数値流体シミュレーションコード
37. **センター外設置装置・技術**
38. 変形機構付きガイドブロック（SPring-8 BL04B1ビームライン）
39. X線その場観察弾性波速度測定装置（SPring-8 BL04B1ビームライン）